

# Nanotech CUPAL 放射光分析初級/中級コース (第1回)

## - X線小角散乱 -

1日目

日時：2019年10月30日（水）13：00～17：30

場所 高エネルギー加速器研究機構（KEK）PF研究棟2階会議室

受付 12：45～13：00

時間	内容	講師
12:30-13:00	(必要な方のみ) 光源棟安全ビデオ	
13:00-13:10	ガイダンス	伴 弘司
13:10-14:20	講義「放射光による小角X線散乱装置」	清水 伸隆
14:30-16:15	講義 「小角X線散乱の手法と実施例」	山本 勝宏
16:30-17:30	ビームライン見学	清水 伸隆

2日目

日時：2019年10月31日（木）9：00～16：00

場所 高エネルギー加速器研究機構（KEK）放射光科学研究施設（フォトンファクトリー）

時間	内容	講師
9:00-12:00	9:00 BL-6Aに集合 ビームライン実習1. 小角X線散乱法による典型的な高分子 材料の測定&データ解析	高木 秀彰
12:00-13:00	休憩	
13:00-16:00	13:00 BL-6Aに集合 ビームライン実習2. 小角X線散乱法による典型的な高分子 材料の測定&データ解析	高木 秀彰

連絡先：CUPAL事務局

伴 弘司（居室）029-864-5634（PHS）029-864-5200（4949）

宇津野恵美（PHS）029-864-5200（2522）